

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

09.06.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 6月13日

出 願 番 号
Application Number:

特願2003-170051

[ST. 10/C]:

[JP2003-170051]

出 願 人 Applicant(s):

独立行政法人理化学研究所

REC'D 1 0 SEP 2004

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 8月26日

1) 1



【書類名】 特許願

【整理番号】 A35048H

【提出日】 平成15年 6月13日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 田代 英夫

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 近藤 恭光

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 橘内 徳司

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 畠山 哲

【特許出願人】

【識別番号】 000006792

【氏名又は名称】 理化学研究所

【代理人】

【識別番号】 110000109

【氏名又は名称】 特許業務法人特許事務所サイクス

【代表者】 今村 正純

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 170347

【納付金額】 21,000円

【その他】 国等の委託研究(文部科学省 科学技術振興調整費ゲノ

ムフロンティア開拓研究推進制度「次世代DNAマイク

ロアレイシステムの開発」)の成果に係る特許出願(産





業再生法第30条の適用を受けるもの)

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0205404

【プルーフの要否】 要



【書類名】明細書

【発明の名称】生体分子マイクロアレイ用基板、生体分子マイクロアレイ、相互作用促進用装置および方法、ならびに、相互作用の検出方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子 マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット 用平面を有し(以下、「突出スポット部」という)、かつ

少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

【請求項2】前記突出スポット部周辺の基板表面が、略V字型底面を形成する請求項1に記載の基板。

【請求項3】基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子 マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット 用平面を有し(以下、「突出スポット部」という)、

隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ

少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

【請求項4】前記導電性物質が、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステンレス、銅、導電性酸化物、または導電性プラスチックである請求項1~3のいずれか1項に記載の基板。

【請求項5】前記基板は、基板全体が導電性物質からなるか、または、基板表面 に導電性物質被覆層を有する請求項1~4のいずれか1項に記載の基板。

【請求項6】前記導電性被覆層を有する基板が、ガラス、金属、シリコン、またはプラスチックからなる請求項5に記載の基板。

【請求項7】前記突出スポット部の高さが、 $10\sim500\mu$ mである請求項 $1\sim6$ のいずれか1項に記載の基板。



【請求項8】前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角が、90度以上である請求項1~7のいずれか1項に記載の基板。

【請求項9】前記スポット用平面が粗面化されている請求項1~8のいずれか1 項に記載の基板。

【請求項10】請求項1~9のいずれか1項に記載の基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイ。

【請求項11】前記生体分子は、DNA、RNA、PNA、蛋白、ポリペプチド、糖化合物、脂質、天然低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種である請求項10に記載の生体分子マイクロアレイ。

【請求項12】基板上に1つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、

前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設けられた電極、および

前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源 を有する、生体分子の相互作用促進用装置であって、

前記生体分子マイクロアレイを構成する基板は、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する生体分子固定化用スポット(以下、「突出スポット部」という)を有し、

少なくとも前記突出スポット部は導電性物質表面を有し、

前記スポット用平面の導電性物質表面に生体分子が固定化され、前記生体分子 固定化スポットが形成されており、かつ

前記基板は、前記基板上の突出スポット部以外の表面に、前記突出スポット部の導電性物質表面と通電可能な端子を有することを特徴とする、生体分子の相互作用促進用装置。

【請求項13】前記基板上の突出スポット部以外の表面は、導電性物質被覆層を有し、前記端子は、前記導電性物質被覆層に含まれるか、または、前記導電性物質被覆層と通電可能であり、かつこの導電性物質被覆層と突出スポット部の導電性物質表面とは、一体の導電性物質被覆層として設けられている請求項12に記



載の装置。

【請求項14】前記生体分子マイクロアレイが、請求項10または11に記載の 生体分子マイクロアレイである請求項12または13に記載の装置。

【請求項15】前記スポット用平面と電極との距離が、 $1\sim500\mu$ mである請求項 $12\sim14$ のいずれか1項に記載の装置。

【請求項16】前記マイクロアレイと電極との間に、非導電性スペーサーを有する請求項12~15のいずれか1項に記載の装置。

【請求項17】前記マイクロアレイの生体分子スポットを有する面に対向するように設けられた電極が、透明電極である請求項12~16のいずれか1項に記載の装置。

【請求項18】温度制御手段を更に有する請求項12~17のいずか1項に記載の装置。

【請求項19】請求項12~18のいずれか1項に記載の装置を用いる、生体分子の相互作用促進方法であって、

前記マイクロアレイと電極との間に、ターゲット生体分子を含む溶液を配置し、かつ、

前記マイクロアレイと電極との間に電界を印加することを特徴とする、生体分子の相互作用促進方法。

【請求項20】前記マイクロアレイと電極との間に印加される電界が、0.001~10MV/mである請求項19に記載の方法。

【請求項21】前記ターゲット生体分子が、蛍光標識されている請求項19または20に記載の方法。

【請求項22】ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた請求項10または11に記載のマイクロアレイの各生体分子固定化スポット上の生体分子と前記ターゲット生体分子との間の相互作用を、共焦点型検出器によって検出することを特徴とする生体分子の相互作用の検出方法。

【請求項23】前記マイクロアレイは、請求項19~21のいずれか1項に記載の方法を用いて、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか



、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた、請求項 22に記載の方法。

【請求項24】前記固定化スポット上の生体分子および/または前記ターゲット 生体分子が蛍光標識されている請求項22または23に記載の方法。

【請求項25】前記共焦点型検出器によって、マイクロアレイ表面の突出スポット部とそれ以外の部分の高さおよび/または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の前記突出スポット部を反射像として検出する請求項22~24のいずれか1項に記載の方法。

【請求項26】前記反射像として検出された突出スポット部からの蛍光を検出することにより、生体分子の相互作用を検出する請求項25に記載の検出方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、生体分子固定の定量化及びデジタル解析が可能な生体分子マイクロアレイ用基板、前記基板に生体分子が固定されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイ、前記マイクロアレイを用いる、生体分子の相互作用促進用装置および相互作用促進方法、ならびに、生体分子の相互作用の検出方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

遺伝子診断や病原菌の特定、あるいは一塩基多型の検出等、ある種の核酸(ターゲット核酸)を検出する目的で、プローブ核酸とターゲット核酸とのハイブリダイゼーションが利用されている。近年、多数のプローブ核酸を基板に固定したDNAチップやDNAマイクロアレイが実用されるようになり、ターゲット核酸の検出に使用されている。

[0003]

DNAチップやDNAマイクロアレイの作製においては、基板にDNAを多数スポットとして整列させて固定化する必要がある。DNAの固定化には、例えば、チオールを一本鎖DNAに接合させ、チオール化した一本鎖DNAを、例えば、金属基板に固定化する方法が取られている。そして、固定化されたDNAに被



検体であるターゲットDNAを作用させ、ハイブリダイゼーションの有無を検出する。ハイブリダイゼーションの有無は、例えば、蛍光法を用いて、ターゲット DNAとハイブリダイズした固定化DNAのスポットの蛍光を測定することによって検出することができる。

[0004]

スポッティング型のDNAマイクロアレイは、プローブDNAを含む液滴を基板上に 載せて乾かすことによって作製される(非特許文献 1 参照)。そのため、安価に 作製できるという利点がある反面、基板上に固定されるDNAの均一さが保証され ない、すなわち、DNA検出スポット部の寸法や形状がばらつくという欠点がある 。これらの欠点は、例えばDNA固定化基板において基板全面にDNA固定化処理(PL L処理)がされていることや、また基板面が平らであることなどに起因する。

[0005]

さらに、スポッティング型のDNAマイクロアレイの場合、DNA検出スポット部の 周囲に付着した固相化剤の存在により、ターゲットDNAが非特異的に基板上に吸 着し、ノイズの上昇を引き起こし、S/N比を低下させるという問題もあった(非特許文献 1 参照)。

[0006]

また、蛍光測定時において、蛍光部分を特定するグリッディングという操作が行われる。グリッディングは、アレイ上のスポットの縦横の数やスポット間隔、スポットの直径の大きさを入力し、スポットを円で囲む操作をいう(非特許文献 1参照)。しかし、スタンプ形状および位置が安定していないと、蛍光解析時のグリッディング操作に非常に時間がかかる上、正確な解析が困難となる。また、グリッディング操作に非常に時間がかかる上、正確な解析が困難となる。また、グリッディングは、スポットの位置がずれているとスポットを正確に囲むことが出来ないため、ソフトウェアに、自動で位置を補正する機能が付いている。しかるに、すべての操作が自動になっているわけではなく、手動でスポットの開始点の設定や目視によりすべてのスポットのグリットを確認し補正する必要がある。この操作は非常に煩雑であり、DNAスポットの数が数千以上になると非常に時間がかかる作業となり、解析スピードを遅らせる要因となっている。

[0007]



一方、基板上に固定化されたプローブDNAと試料ターゲットDNAをハイブリダイゼーションさせるには、通常、十数時間要し、しかも、多量の試料ターゲットDNAが必要とされる。そのため、ハイブリダイゼーション時間および大量の試料の調製に、莫大な時間と費用、労力が必要とされている。特に、低発現遺伝子の解析を行う場合、極めて多くのターゲット試料が必要となる。

[0008]

【非特許文献1】「必ずデータが出るDNAマイクロアレイ実践マニュアル 基本原理、チップ作製技術からバイオインフォマティクスまで」、第1版、羊土社、2002年12月1日、p. 19-21、35、106-108

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

そこで本発明の目的は、生体分子マイクロアレイに一定形状の生体分子固定化領域をもつ基板及び生体分子の相互作用、特に核酸のハイブリダイゼーションを高速に行い、かつ微量サンプルの相互作用を促進させ、さらに高速・高感度に相互作用を検出し解析する手段を提供することである。

更に、本発明は、生体分子の相互作用を促進して、相互作用し得る生体分子間で効率的に相互作用を形成させることができる相互作用促進用装置および方法を 提供することを目的とする。

更に、本発明は、グリッディング操作を自動で行う手段を提供することにより、生体分子マイクロアレイからの蛍光データの収集およびデジタル解析の自動化を可能にすることを目的とする。

より詳しくは、本発明は、高感度で生体分子の相互作用を検出でき、好ましくは、併せてグリッティングを自動で行うこともできる生体分子マイクロアレイ用基板、そのような基板に生体分子が固定化された生体分子マイクロアレイを提供することを目的とする。

更に、本発明は、グリッティングを自動で行うことを可能にする生体分子の相 互作用の検出方法を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】



上記本発明の目的を達成するための手段は、以下の通りである。

(1) 基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット 用平面を有し(以下、「突出スポット部」という)、かつ

少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およ びスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

- (2)前記突出スポット部周辺の基板表面が、略V字型底面を形成する(1)に 記載の基板。
- (3) 基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板であって、

前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット 用平面を有し(以下、「突出スポット部」という)、

隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ

少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする基板。

- (4) 前記導電性物質が、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステンレス、銅、導電性酸化物、または導電性プラスチックである(1)~(3)のいずれかに記載の基板。
- (5) 前記基板は、基板全体が導電性物質からなるか、または、基板表面に導電性物質被覆層を有する(1)~(4)のいずれか1項に記載の基板。
- (6)前記導電性被覆層を有する基板が、ガラス、金属、シリコン、またはプラスチックからなる(5)に記載の基板。
- (7) 前記突出スポット部の高さが、 $10\sim500~\mu$ mである(1) \sim (6)のいずれかに記載の基板。
- (8) 前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角が、90度以上である(1)~(7)のいずれかに記載の基板。
- (9) 前記スポット用平面が粗面化されている (1) \sim (8) のいずれかに記載



の基板。

- (10) (1) ~ (9) のいずれか1項に記載の基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイ。
- (11) 前記生体分子は、DNA、RNA、PNA、蛋白、ポリペプチド、糖化合物、脂質、天然低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種である(10) に記載の生体分子マイクロアレイ。
- (12) 基板上に1つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、

前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設けられた電極、および

前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源 を有する、生体分子の相互作用促進用装置であって、

前記生体分子マイクロアレイを構成する基板は、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する生体分子固定化用スポット(以下、「突出スポット部」という)を有し、

少なくとも前記突出スポット部は導電性物質表面を有し、

前記スポット用平面の導電性物質表面に生体分子が固定化され、前記生体分子 固定化スポットが形成されており、かつ

前記基板は、前記基板上の突出スポット部以外の表面に、前記突出スポット部の導電性物質表面と通電可能な端子を有することを特徴とする、生体分子の相互作用促進用装置。

- (13) 前記基板上の突出スポット部以外の表面は、導電性物質被覆層を有し、 前記端子は、前記導電性物質被覆層に含まれるか、または、前記導電性物質被覆 層と通電可能であり、かつこの導電性物質被覆層と突出スポット部の導電性物質 表面とは、一体の導電性物質被覆層として設けられている(12)に記載の装置
- (14) 前記生体分子マイクロアレイが、(10) または(11) に記載の生体分子マイクロアレイである(12) または(13) に記載の装置。



- (15) 前記スポット用平面と電極との距離が、 $1\sim500\,\mu$ mである(12) \sim (14) のいずれかに記載の装置。
- (16) 前記マイクロアレイと電極との間に、非導電性スペーサーを有する (12) \sim (15) のいずれかに記載の装置。
- (17) 前記マイクロアレイの生体分子スポットを有する面に対向するように設けられた電極が、透明電極である(12)~(16) のいずれかに記載の装置。
- (18) 温度制御手段を更に有する(12)~(17) のいずかに記載の装置。
- (19) (12) ~ (18) のいずれかに記載の装置を用いる、生体分子の相互 作用促進方法であって、

前記マイクロアレイと電極との間に、ターゲット生体分子を含む溶液を配置し、かつ、

前記マイクロアレイと電極との間に電界を印加することを特徴とする、生体分子の相互作用促進方法。

- (20) 前記マイクロアレイと電極との間に印加される電界が、0.001~10 MV/mである(19) に記載の方法。
- (21)前記ターゲット生体分子が、蛍光標識されている請求項19または20 に記載の方法。
- (22) ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた(10)または(11)に記載のマイクロアレイの各生体分子固定化スポット上の生体分子と前記ターゲット生体分子との間の相互作用を、共焦点型検出器によって検出することを特徴とする生体分子の相互作用の検出方法。
- (23)前記マイクロアレイは、(19)~(21)のいずれかに記載の方法を用いて、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれているか、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境下に置かれていた、(22)に記載の方法。
- (24) 前記固定化スポット上の生体分子および/または前記ターゲット生体分子が蛍光標識されている(22) または(23) に記載の方法。
 - (25) 前記共焦点型検出器によって、マイクロアレイ表面の突出スポット部と



それ以外の部分の高さおよび/または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の前記突出スポット部を反射像として検出する(22)~(24)のいずれかに記載の方法。

(26)前記反射像として検出された突出スポット部からの蛍光を検出することにより、生体分子の相互作用を検出する(25)に記載の検出方法。

[0011]

【発明の実施の形態】

以下、本発明について更に詳細に説明する。

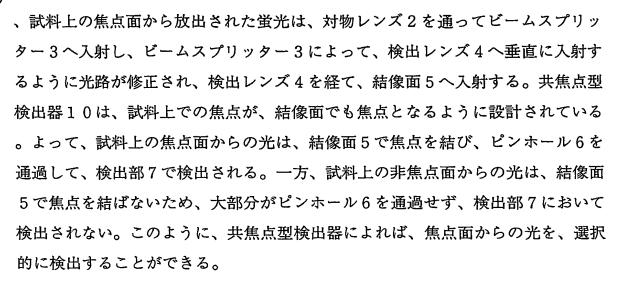
[基板]

本発明の生体分子マイクロアレイ用基板は、基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板であって、前記生体分子固定化用スポットが、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する(以下、「突出スポット部」という)。更に、本発明の生体分子マイクロアレイ用基板は、少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、導電性物質からなるか(以下、「第一の態様」という)、または、隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ、少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなる(以下、「第二の態様」という)ことを特徴とする。

本発明の基板では、生体分子固定化用スポットが、突出スポット部の頂上の平面に設けられている。そのため、本発明の第一の態様の基板では、前記突出スポット部頂上のスポット用平面(生体分子固定化用スポット)は、前記突出スポット部周辺の基板表面より一段高い位置にあり、両者間に高低差が生じる。

[0012]

一方、本発明において、生体分子の相互作用の検出に用いられる共焦点型検出器は、試料上の焦点面からの反射光や蛍光を、光学系の結像面に置かれたピンホールに通して検出する。図1に、本発明で使用される共焦点型検出器10の光学系の概略図を示す。図1の実線aは、入射光を表す。実線bは、焦点面からの反射光または蛍光を表し、破線は、非焦点面からの反射光または蛍光を表す。共焦点型検出器10では、マイクロアレイ1上の焦点面から反射した反射光、および



[0013]

本発明の第一の態様の基板では、前記突出スポット部周辺の基板表面と、前記突出スポット部頂上のスポット用平面(生体分子固定化用スポット)との高低差が、生体分子とターゲット生体分子との相互作用の検出において使用する共焦点型検出器の焦点深度以上であれば、共焦点型検出器の焦点を、突出スポット部頂上のスポット用平面の高さに合わせることにより、検出器において、突出部周辺の基板表面からの蛍光や反射光よりも、突出スポット部頂上のスポット用平面からの蛍光や反射光を、より高い強度で検出することができる。従って、本発明の基板の突出スポット部頂上のスポット用平面に生体分子を固定化したマイクロアレイでは、スポット上の情報、例えば、ターゲット生体分子との相互作用の有無を、高感度で検出することができる。

[0014]

本発明の第二の態様の基板は、隣り合う突出スポット部が、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ、少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることを特徴とする。本発明の第二の態様の基板の一例を、図5に示す。

[0015]

本発明の第一および第二の態様の基板において、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角は、90度以上であることが好ましい。好ましくは、90~135度である。図2(a)は、本発明の基板の



一部の断面図である。ここで、「突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角」とは、図 2 (a) における角度 θ をいう。角度 θ は、例えば、突出スポット部を、突出スポット部周辺の基板表面に対して垂直に切断し、その断面から求めることができる。

[0016]

このように、本発明の基板において、突出スポット部頂上のスポット用平面と 突出スポット部側面とのなす角が90度以上であることにより、即ち、突出スポット部底面の大きさが、突出スポット部頂上のスポット用平面の大きさ以上であることにより、グリッティングを自動で行って、生体分子固定化用スポットの位置および大きさを特定することができるという利点がある。以下に、この点について、詳述する。

[0017]

図2 (a) に示すように、突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角が90度以上である場合、共焦点型の検出器を使用して反射光を検出する際に、突出スポット部頂上のスポット用平面に対して垂直な方向から照射した光(図2(a)に矢印で表される光)に対する突出スポット部側面からの反射光は、入射光と同一方向には反射しない。一方、突出スポット部頂上のスポット用平面からの反射光は、入射光と同一方向に反射する。このため、共焦点型検出器では、突出スポット部頂上のスポット用平面からの反射光のみが検出され、側面からの反射光は検出されない。こうして得られた反射像には、突出スポット部頂上のスポット用平面に相当する像が、反射像として得られ、突出スポット部側面に相当する部分は、反射光がほとんど検出されないので黒色の縁取りとして表れる。この反射像では、黒い縁取りの内部が生体分子スポットに相当するため、この反射像により、スポットの大きさおよび位置を特定することができる。本発明では、このような原理により、自動グリッティングを行うことが可能である。

[0018]

また、本発明の第一の態様の基板において、突出スポット部の高さが相互作用の検出に使用する共焦点型検出器の焦点深度以上である場合は、共焦点型検出器



の焦点を、突出スポット部頂上のスポット用平面の高さに合わせれば、突出スポット部頂 ット部周辺の基板表面からの反射光は、焦点が合わないため、突出スポット部頂 上のスポット用平面からの反射光よりもはるかに弱い強度でしか、検出されない。本発明では、この高低差を利用して自動グリッティングを行うことも可能である。但し、前記突出スポット部の高さが相互作用の検出に使用する共焦点型検出 器の焦点深度より小さい場合であっても、前述のように、反射像において、突出スポット部側面に相当する部分が黒色の縁取りとして表れれば、スポットの大きさおよび位置を特定することが可能である。

[0019]

また、本発明の第一の態様の基板では、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角が90度未満であっても、突出スポット部の高さが相互作用の検出に使用する共焦点型検出器の焦点深度以上である場合は、スポット用平面と、突出スポット部周辺の基板表面との高低差を利用して、反射像によって、スポット用平面の位置および大きさを特定し、自動でグリッティングを行うことができる。前記突出スポット部頂上のスポット用平面と突出スポット部側面とのなす角が90度である場合、前記突出スポット部の形状は、例えば、円柱状または角柱状であることができる。

[0020]

さらに、本発明の第一の態様の基板は、前記突出スポット部頂上のスポット用平面と前記突出スポット部側面とのなす角が、90度以上であり、かつ、前記突出スポット周辺の基板表面が、略V字型底面を形成する基板であることもできる。このような基板では、共焦点型検出器で検出されるスポット用平面からの反射光強度が、基板上のスポット用平面以外の部分からの反射光強度より強くなるため、この反射光強度の違いにより、スポット用平面の位置および大きさを特定することができる。図4は、「略V字型底面」を有する基板の一部の拡大図である。本発明において、「略V字型底面」とは、例えば、隣り合う突出スポット部間の突出スポット部周辺の基板表面が平面ではなく、図4に示すように、略V字を形成していることをいう。

[0021]



更に、本発明の第一の態様の基板は、少なくとも、前記突出スポット部周辺の 基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、導電性物質からなる ことを特徴とする。製造の容易さや製造コストを考慮すれば、本発明の第一の態 様の基板は、基板上の、前記突出スポット周辺以外の基板表面も、導電性物質か らなるものであることが好ましい。また、本発明の第二の態様の基板は、少なく ともと突出スポット部側面および突出スポット部平面が、導電性物質からなるこ とを特徴とする。

[0022]

本発明では、前記のように、第一の態様の基板においては、少なくとも、突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面が、第二の態様の基板においては、少なくとも、突出スポット部側面およびスポット用平面が、導電性物質からなることにより、後述するように、前記基板に対向する電極を設け、電界を印加することによって、スポット用平面に固定化された生体分子とターゲット生体分子との相互作用を促進することができる。例えば、ターゲット生体分子の濃度が低い場合でも、良好な相互作用結果を得ることができ、また、濃度が同一の場合には、より短時間で所定の相互作用結果を得ることができる。

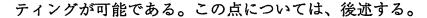
[0023]

また、本発明では、前記導電性物質が、光を反射する性質を有するものであれば、反射光によって、生体分子固定化スポットの大きさおよび位置を特定し、自動でグリッティングを行うことができる。この点については後述する。

[0024]

本発明において、前記突出スポット部の高さは、相互作用の検出において使用する共焦点型検出器の焦点深度以上の高さになるように、適宜設定することができ、通常の共焦点型検出器の焦点深度を考慮すると、例えば、10~500μmであることができる。但し、前述のように、基板上の突出スポット部頂上のスポット用平面とそれ以外の部分との形状の差による反射光強度の相違を検出することによって自動グリッティングを行う場合は、前記突出スポット部の高さは、相互作用の検出に使用する共焦点型検出器の焦点深度より小さくても、自動グリッ





また、前記突出スポット部の高さを決定する際は、生体分子のスポット形成(スタンピング)に使用するニードルの直径や、プローブ核酸等の生体分子溶液のスポット量も考慮する必要がある。例えば、直径 100μ mの円形の突出スポット部に対して直径 130μ m程度のニードルを用いて生体分子をスポットする場合、突出スポット部の高さが 15μ m以上であれば、表面張力のため、突出スポット部頂上のスポット用平面から生体分子溶液が流れ出すことなく、固定化用スポットのみに、生体分子が固定化されるため、好ましい。

[0025]

本発明の基板において、突出スポット部頂上のスポット用平面の形状は、スポットされた生体分子を保持し得る形状であれば、いずれの形状であることもでき、例えば、円形や正方形であることができる。前記スポット用平面の大きさは、スポットに用いるニードルやスポットする生体分子溶液の量に応じて適宜設定することができ、例えば、10~500µmとすることができる。ここで、「スポット用平面の大きさ」とは、例えば、スポット用平面の形状が円形の場合は、その直径をいい、スポット用平面の形状が正方形の場合は、その一辺の長さをいう。

突出スポット部底面の形状は、特に限定されないが、製造の容易さ等を考慮すれば、スポット用平面と同様の形状であることが好ましい。図2(b)は、本発明の基板上の突出スポット部の概略図である。ここで、「突出スポット部底面の形状」とは、図2(b)の斜線部をいう。

[0026]

前記突出スポット部頂上のスポット用平面は、粗面化されていてもよい。例えば、前記突出スポット部頂上のスポット用平面は、深さ方向と略水平方向に、相互作用の検出において使用する共焦点型検出器の焦点深度以内の深さの凹凸を有していてもよい。図3に、粗面化されたスポット用平面の一例(部分拡大図)を示す。粗面化されたスポット用平面の一例としては、図3に示すような、数 μ m角の格子状の形状を設けたスポット用平面を挙げることができる。このように、スポット用平面が粗面化されていることにより、後述するように、電気泳動また



は誘電泳動によるターゲット生体分子の濃縮効果を得る場合に、凹凸の角(エッジ)部分に強電界が生じ、相互作用が更に促進されるという利点がある。

$[0\ 0\ 2\ 7]$

スポット用平面の粗面化方法は特に限定されず、例えば、本発明の基板がプラスチック成型基板の場合、フォトリソグラフィーによりエッチングした母材を、電鋳法により反転写した微細加工金型を用いることにより、スポット用平面が粗面化された基板を製作することができる。

[0028]

本発明の基板は、基板全体が導電性物質からなるか、また、基板表面に導電性 物質被覆層を有するものであることができる。

前述のように、反射像によって自動グリッティングを行う場合には、前記導電 性物質は、光を反射する性質を有する物質から選択する。

また、金属とチオール基との結合を利用して、プローブ核酸の固定化を行う場合は、前記導電性物質は、チオール基と結合性を有する金属から選択する。

[0029]

前記導電性物質としては、例えば、金属(例えば、金、ニッケル、白金、銀、チタン、アルミニウム、ステンレス、銅)、導電性酸化物(例えば、 In_2O_5/SnO_2)および導電性プラスチック(例えば、ポリアセチレン)を挙げることができる。

また、導電性物質被覆層を有する基板としては、ガラス、シリコン、プラスチック、具体的には、ポリプロピレン等の基板の表面に、前記導電性物質を被覆したものを挙げることができる。基板上の導電性物質被覆層の厚さは、特に限定されるものではなく、例えば、 $0.1\sim10~\mu$ mとすることができる。

[0030]

本発明において、前記基板が、金属からなるものである場合は、所望の形状の 突出スポット部に対応した凹部を有する鋳型に、熔融した金属を注入して鋳造す ることにより、本発明の基板を得ることができる。また、プレス成形によって、 金属製基板を得ることもできる。本発明の基板は、金属からなる基板の上に、導 電性物質を被覆したものであることもできる。



[0031]

本発明の基板が、シリコンまたはプラスチック製の基板上に導電性物質の被覆を有するものである場合は、例えば、所望の形状の突出スポット部に対応した凹部を有する成形型を用いてシリコンまたはプラスチックを成形し、そのシリコンまたはプラスチック製の基板上に、導電性物質を、蒸着、メッキ等によって被覆することにより、本発明の基板を得ることができる。

[0032]

また、本発明の基板は、平板状の基板上に導電性被覆層を被覆した後に、エッチング等により突出スポット部を形成することによって製造することもできる。

[0033]

次に、本発明の基板が、ガラス基板上に金被覆層を有するものである場合の、 基板の製造方法の一例を説明する。但し、本発明はこの態様に限定されるもので はない。

まず、スライドガラスの表面に、真空蒸着装置により、クロム、チタン、ニッケル等を蒸着し、次いで、その上に金を蒸着する。この金蒸着スライドガラス上に、ポジ型レジストをスピンコーターで塗布し、例えば60℃でオーブンにより1時間ベーキングする。

次いで、紫外線露光装置により、フォトマスクを通してスライドガラスに紫外線を照射する。このとき、フォトマスクとしては、所望の形状の突出スポット部に対応したパターンを有するものを使用する。紫外線照射後、現像液によって現像を行えば、金蒸着スライドガラス表面に、レジストパターンを形成することができる。

[0034]

次いで、レジストパターン周辺の金表面を、金エッチャントによってエッチングする。金エッチング後の基板を超純水によって洗浄した後、金の下に蒸着されたクロム、チタン、ニッケル等を除去するために、エッチャントにより更にエッチングを行い、超純水によって洗浄する。

アセトン等によってレジストを溶解した後、超純水によって洗浄し、更に残っているレジストを完全に除去するために、ピラニア溶液(硫酸:過酸化水素=1





: 1) に例えば10分間漬けて、超純水で洗浄する。これにより、フォトマスクに対応した金パターンを有するガラス基板を得ることができる。

[0035]

次に、上記基板を、フッ化水素酸に浸漬し、露出しているガラス表面をエッチングする。このときに使用するフッ化水素酸の濃度および浸漬時間は、所望の突出スポット部の高さに応じて適宜設定することができる。

[0036]

次に、前述と同様に、金およびクロム等のエッチングを行った後、ピラニア溶液および超純水によって基板を洗浄し、所望の形状の突出スポット部を有するガラス基板を得ることができる。

このガラス基板に、前述と同様に、クロム等を蒸着し、次いで、金を蒸着する ことによって、突出部を有し、かつ、金被覆を有する基板を得ることができる。

[0037]

本発明において、基板全体の大きさ、基板上の突出スポット部の数および集積度は特に限定されず、適宜設定することができる。例えば、本発明の基板は10~20, 000mm 2 の大きさの基板上に、突出スポット部を、10~50, 000個程度有するものであることができる。

[0038]

[生体分子マイクロアレイ]

本発明の核酸マイクロアレイは、本発明の基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されていることを特徴とする生体分子マイクロアレイである。前記生体分子は、DNA、RNA、PNA、蛋白、ポリペプチド、糖化合物、脂質、天然低分子、および合成低分子からなる群から選ばれる少なくとも一種であることができ、目的に応じて選択することができる。

ここで、糖化合物としては、例えば、単糖、オリゴ糖、多糖、糖鎖複合体、糖 蛋白質、糖脂質、およびそれら誘導体などを挙げることができる。

脂質としては、例えば、脂肪酸、リン脂質、糖脂質、グリセリドなどを挙げる ことができる。



天然低分子としては、例えば、ホルモン分子や抗生物質、毒物、ビタミン類、 生理活性物質、二次代謝産物などを挙げることができる。

合成低分子としては、例えば、天然低分子の合成物、およびそれら誘導体など を挙げることができる。

[0039]

本発明では、生体高分子が核酸であり、かつ、前記導電性物質が金属である場合、プローブ核酸を生体分子固定化用スポット(突出スポット部)に固定化するために、突出スポット部頂上のスポット用平面の金属と反応性を有する基を一端に有する核酸を含む溶液を、スポッティング溶液として用いることができる。そのような基としては、チオール基を挙げることができる。チオール基を有する核酸の金属表面への固定化は、公知の方法によって行うことができ、例えば、J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 9787-9792を参照することができる。

[0040]

金属表面へのDNAの固定化方法としては、金属(表面酸化被膜を活性化させ 水酸基を提示させたもの)に対して以下の処理を行う方法を用いることもできる

- (1) アミノシラン処理した基板表面に、UV照射することにより、DNAを固定化する。
- (2) アミノシラン、NHS (N-ヒドロキシスクシンイミド)-ビオチン、アビジンによって順次処理した基板表面に、ビオチン化DNAを固定化する。
- (3) アミノシラン、マレイミド-ビオチン、アビジンによって順次処理した基板表面に、ビオチン化DNAを固定化する。
- (4) アミノシラン、次いでグルタルアルデヒドによって処理した基板表面に、 アミノ化DNAを固定化する。
- (5) アミノシラン、次いでカルボジイミドによって処理した基板表面に、アミノ化DNAを固定化する。
- (6)アミノシラン処理した基板表面に、カルボキシ化DNAを固定化する。
- (7) アミノシラン処理した基板表面に、リン酸化DNAを固定化する。
- (8) アミノシラン、次いでNHS-マレイミド化合物によって処理した基板表面



に、チオール化DNAを固定化する。

- (9) エポキシシラン処理した基板表面に、アミノ化DNAを固定化する。
- (10) チオールシラン処理した基板表面に、チオール化DNAを固定化する。

[0041]

また、DNA以外の生体分子についても、上記のような、UV照射による固定化や、チオール基、アミノ基、カルボキシル基、リン酸基などの官能基を介しての固定化が可能である。

[0042]

前記スポット用平面への生体分子溶液のスポッティングは、常法により行うことができ、例えば、先端に生体分子溶液を保持したニードルを、突出スポット部頂上のスポット用平面に接触させることにより行うことができる。ここで使用されるスポッティング用装置としては、例えば、特開2001-46062号公報および特開2003-57236号公報に記載の装置を挙げることができる。スポット量は、スポット用平面から生体分子溶液が流れ出さないように、スポット用平面の大きさや、突出スポット部の高さに応じて、適宜設定することができる。

[0043]

[相互作用促進用装置、相互作用促進方法]

本発明は更に、

基板上に1つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、 前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設 けられた電極、および

前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源 を有する、生体分子の相互作用促進用装置であって、

前記生体分子マイクロアレイを構成する基板は、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有する生体分子固定化用スポット(突出スポット部)を有し、

少なくとも前記突出スポット部は導電性物質表面を有し、

前記スポット用平面の導電性物質表面に生体分子が固定化され、前記生体分子



固定化スポットが形成されており、かつ

前記基板は、前記基板上の突出スポット部以外の表面に、前記突出スポット部の導電性物質表面と通電可能な端子を有することを特徴とする、生体分子の相互作用促進用装置

に関する。このような生体分子の相互作用としては、例えば、プローブ核酸とターゲット核酸とのハイブリダイゼーション、抗原一抗体相互作用、レセプターーリガンド相互作用、タンパクータンパク相互作用、DNAータンパク相互作用を挙げることができる。

前記基板上の突出スポット部以外の表面は、導電性物質被覆層を有し、前記端子は、前記導電性物質被覆層に含まれるか、または、前記導電性物質被覆層と通電可能であり、かつこの導電性物質被覆層と突出スポット部の導電性物質表面とは、一体の導電性物質被覆層として設けられていることが好ましい。前記装置における生体分子マイクロアレイは、前記本発明の生体分子マイクロアレイであることができる。

[0044]

更に、本発明は、前記の生体分子の相互作用促進用装置を用いる、生体分子の相互作用促進方法であって、

前記マイクロアレイと電極との間に、ターゲット生体分子を含む溶液を配置し、かつ、

前記マイクロアレイと電極との間に電界を印加することを特徴とする、生体分子の相互作用促進方法

[0045]

に関する。

前記装置における生体分子マイクロアレイは、突出スポット部を有するため、マイクロアレイ上の突出部頂上の生体分子が固定化された平面と、前記マイクロアレイの生体分子スポットを有する面に対向するように設けられた電極 (対向電極) の、前記平面と対向する面との間で電界密度が高まり、溶液中のターゲット生体分子が、電気泳動 (直流電源を使用した場合) または誘電泳動 (交流電源を使用した場合) によって突出部近傍に濃縮される。



これにより、突出スポット部に固定化された生体分子と、ターゲット生体分子 との相互作用を促進させることができる。特に、前記生体分子マイクロアレイに おいて、生体分子が固定化されたスポット平面が粗面化されている場合、例えば 、スポット平面に、共焦点型検出器の焦点深度以内で深さ方向と略水平方向に凹 凸を有する場合は、凹凸の角(エッジ)部分に強電界が生じ、相互作用が更に促 進されるという利点がある。

[0046]

前記対向電極は、前記生体分子マイクロアレイと対向電極との間に電界を印加することができるものであれば、特に制限はない。図6 (a)に、本発明の生体分子の相互作用促進用装置の概略図を、図6 (b)に、本発明の生体分子の相互作用促進用装置の断面図を示す。本発明において、対向電極は、導電性物質、例えば、金属、導電性酸化物、導電性プラスチック、等からなる基板であることができ、また、マイクロアレイと対向する面に、導電性物質被覆層を有する基板からなるものであることもできる。本発明では、特に、前記対向電極が、例えば、ITO(酸化インジウムスズ)、酸化スズなどの透明電極であれば、生体分子の相互作用中に、同時に、透明電極の上から、共焦点型検出器で反射光および蛍光の検出を行うことができ、相互作用をリアルタイムで検出することができる。また、前記生体分子マイクロアレイを構成する基板が、光透過性のガラスやプラスチック上に、透明の導電性被覆層を設けたものである場合や、基板全体が透明の導電性物質からなる場合も、同様に、相互作用をリアルタイムで検出することができる。

[0047]

また、前記相互作用促進用装置において、生体分子マイクロアレイと対向電極との間に電界を印加するための電源は、直流電源でも、交流電源でもよく、より好ましくは、交流電源が用いられる。直流電源を使用する場合は、高電圧をかけると、ターゲット生体分子溶液が高電圧により電気分解し、気泡等が発生しやすいという懸念があるため、低電圧を使用することが好ましい。ターゲット生体分子としてDNAを使用する場合には、DNAがマイナスに荷電されているため、直流電源を使用する場合は、突出スポット部側が、プラスになるように電界を印



加することが好ましい。交流電源を使用する場合は、低周波交流では、ターゲット生体分子溶液の電気分解により気泡等が発生しやすいという懸念があるため、 高周波交流を使用することが好ましい。

[0048]

前記相互作用促進用装置において、生体分子マイクロアレイと対向電極との間には、生体分子マイクロアレイの突出スポット部を有する領域が覆われないように、非導電性材料からなるスペーサーを挟むことができる。前記非導電性材料としては、例えば、ゴム、ガラス、プラスチックを挙げることができる。本発明の装置では、このスペーサーの厚さにより、生体分子マイクロアレイ上のスポット用平面と対向電極との距離を設定することができ、また、このスペーサーによって囲まれた空間に、ターゲット生体分子を含む溶液を充填することができる。前記スポット用平面と対向電極との距離は、電気泳動または誘電泳動によるターゲット生体分子濃縮の効果が得られる範囲で適宜設定することができ、例えば、1~500 μ mとすることができる。

[0049]

前記相互作用促進用装置は、ヒーター等の温度制御手段を更に有することが好ましい。温度制御手段によって、生体分子周辺の環境を、相互作用に適した温度に制御することにより、相互作用を更に促進することができる。

[0050]

前記装置において、生体分子マイクロアレイと対向電極との間に印加される電界は、前記の生体分子マイクロアレイと対向電極との間の距離を考慮しつつ、電気泳動または誘電泳動によるターゲット生体分子の濃縮の効果が得られる範囲で適宜設定することができ、例えば、0.001~10MV/mとすることができる。

[0051]

本発明では、共焦点検出器によって蛍光を検出することにより生体分子間の相互作用を検出するために、前記の相互作用促進方法に用いられるターゲット生体分子は、蛍光標識されているものであることが好ましい。ターゲット生体分子の蛍光標識は、公知の方法で行うことができる。また、本発明では、マイクロアレ



イに固定化される生体分子が、蛍光標識されていてもよい。マイクロアレイに固 定される生体分子の蛍光標識も、公知の方法で行うことができる。

[0052]

本発明において、ターゲット生体分子溶液に用いるバッファーとして、好ましいものとしては、約6~8付近の解離定数(pKa)を有するものが挙げられる。プローブ核酸とターゲット核酸とのハイブリダイゼーションを効率よく起こさせるためには、pHが中性域であることが好ましいため、中性域で緩衝能を有するバッファーを使用することが好ましい。具体的には、以下のバッファー物質を含むバッファーが挙げられる;ヒスチジン、MES(2-(N-モルホリン)エタンスルホン酸)、マレイン酸、3,3-ジメチルグルタル酸、炭酸、4-ヒドロキシメチルイミダゾール、クエン酸、ジメチルアミノエチルアミン、プロリン酸、グリセロール-2-リン酸、PIPES(ピペラジン-N,N'-ビス(2-エタンスルホン酸))、エチレンジアミン、イミダゾール、MOPS(3-(N-モルホリン)プロパンスルホン酸)、リン酸、TES(N-トリス(ヒドロキシメチル)メチル-2-アミノエタンスルホン酸)、4-メチルイミダゾール、HEPES(N-2-ヒドロキシエチルピペラジン-N'-2-エタンスルホン酸)、N-エチルモルホリン、トリエタノールアミン、トリス(トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン)。

[0053]

「相互作用の検出方法」

本発明は更に、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境に置かれているか、または、ターゲット生体分子と相互作用し得る環境に置かれていた、本発明のマイクロアレイの各生体分子固定化スポット上の生体分子と前記ターゲット生体分子との間の相互作用を、共焦点型検出器によって検出することを特徴とする生体分子の相互作用の検出方法にも関する。共焦点型検出器による反射光および蛍光の検出原理については、前述の通りである。本発明の相互作用の検出方法では、共焦点型検出器を用いて、前述の原理で反射像によってスポットの大きさおよび位置を特定することで、自動グリッティングを行うことができる。即ち、本発明によれば、マイクロアレイ表面の生体分子固定化スポットとそれ以外の部分の高さおよび/または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の生



体分子固定化スポットを、反射像として検出することができる。更に、共焦点型 検出器によって、マイクロアレイからの蛍光を検出するときに、マイクロアレイ 上の突出スポット部頂上のスポット平面の高さに、共焦点型検出器の焦点を合わ せれば、前記スポット平面上の蛍光標識された生体分子(スポットに固定化され た生体分子および/またはターゲット生体分子)からの蛍光を選択的に検出して 、スポットに対応する蛍光像を得ることができる。本発明では、こうして得られ た反射像と蛍光像を重ね合わせることによって、マイクロアレイ上の相互作用が 起こっているスポットを特定することができ、その蛍光強度により、相互作用の 程度を測定することができる。なお、本発明では、インターカレーターを用いて 、インターカレーターからの蛍光を測定することによって相互作用を検出するこ ともできる。

[0054]

特に、本発明では、反射光と蛍光とを同時に検出することができる共焦点型スキャナーを用いることが好ましい。そのような装置の一例を、図7に示す。図7に示す装置では、励起光源(レーザー)21から発生した励起光はミラー22、ダイクロックミラーミラー23、ミラー26、対物レンズ24、を介して試料(マイクロアレイ)25に照射される。反射光は対物レンズ24、ミラー26、ダイクロックミラー23(反射光の一部を透過(数パーセント以下))、ダイクロックミラー27、減光フィルター28、検出レンズ29、ピンホール30を介して反射光検出部31に導かれる。蛍光は2つのダイクロックミラー23、27を透過し、ミラー32にて反射しカットフィルター33、検出レンズ34、ピンホール35を介して蛍光検出部36に導かれる。このような装置によれば、マイクロアレイ表面の生体分子固定化スポットとそれ以外の部分の高さおよび/または形状の差による反射光強度の相違から、マイクロアレイ上の生体分子固定化スポットを反射像として検出し、同時に、そのスポットからの蛍光を検出することによって、生体分子の相互作用を検出することができる。

[0055]

【実施例】

以下、本発明を実施例によって更に説明する。





実施例1

核酸マイクロアレイ用基板の作製

- 1)表面研磨したスライドガラスの表面に、真空蒸着装置により、クロムを250Å厚で蒸着した後、金をその上に2500Å厚で蒸着した。
- 2) 金蒸着スライドガラス上にポジ型レジストS1813 (シプレー社) をスピンコーターで塗布し、60 $^{\circ}$ オーブンにより1時間ベーキングした。
- 3)紫外線露光装置により、フォトマスクを通して上記スライドガラスに紫外光を照射した。フォトマスクは、直径 200μ mの円と 1 辺 200μ mの正方形のパターンがそれぞれ 11×11 個形成されているものを使用した。照射後、現像液 CD-26(シプレー社)により現像を行い、直径約 200μ mの円と正方形のレジストパターンを金表面上に形成した。
- 4) 円と正方形のレジストパターンの周辺分の露出している金表面を金エッチャント(ヨウ化カリウム:ヨウ素:水=6:1:80)により金をエッチングした。超純水で洗浄した後、金のエッチングにより露出したクロムをクロムエッチャント(10%硝酸二セリウムアンモニウム(IV))によりエッチングを行い、超純水で洗浄した。
- 5) アセトンにつけ、レジストを溶解後、超純水で洗浄し、さらに残っているレジストを完全に除去するために、ピラニア溶液(硫酸:過酸化水素=1:1) に10分間つけ、超純水で洗浄した。この段階で、ファトマスク通りに円と正方形の金パターンを有するガラス基板が作製された。
- 6)次に露出しているガラス表面をエッチングするために、上記の金パターンガラス基板を 4.6% フッ化水素酸に 50 分間浸漬した。これにより、ガラス表面は、約 50μ mの深さ分だけ腐食され、またアンダーカットにより金パターンの下も横方向から侵食され、直径約 200μ mの円と 1 辺約 200μ mの正方形のパターンは、約 90μ m(直径又は 1 辺)のパターンとなった。
- 7) 4) と同様に、金とクロムのエッチングを行った後、ピラニア溶液、超純水で基板を洗浄した。
- 8) 1) と同様に、クロムと金を蒸着し、金が表面に蒸着された核酸マイクロアレイ用基板を作製した(図8)。





[0056]

図8 a) は、実施例1で作製された基板をデジタルカメラにて撮影したものである。凹凸が形成されていることが像からわかる。図8 b) は、正方形のスポットについて、共焦点顕微鏡により光学切片を撮像し、3次元構築したものである。基板上に、頂上にスポット用平面を有する突出スポット部が形成されていることがわかる。正方形のスポットの高さは、約50 μ mの高さを有していた。実施例1で得られた基板上のスポット用平面の大きさは、90 μ mであり、突出スポット部周辺の基板表面と、突出スポット部側面とのなす角は、110度であった。

[0057]

実施例 2

核酸マイクロアレイ用基板へのDNAスタンピング

5' - 蛍光色素Cy3を標識したDNA溶液(tatgacaatg aatacggcta cagcaa cagg gtggtggacc tcatg (配列番号1) (遺伝子名GAPDH) 溶液組成:50μM 1×マイクロスポッティング溶液(テレケム社))を、理研で開発したD NAアレイヤーにより、実施例1で作製した核酸マイクロアレイ用基板の突出ス ポット部頂上のスポット用平面へスタンプした。スタンプ針の先端は、直径13 0μmの円形であった。図7に示す蛍光と反射光とを同時に計測することができ るDNAマイクロアレイスキャナーによって、DNA溶液をスタンプした基板か らの蛍光および反射光の計測を行った(図9)。(a)が蛍光像、(b)が反射 光像、(c)が二つの画像の重ね合わせである。ここで使用したDNAマイクロ アレイスキャナーでは、蛍光像は赤色で、反射像は緑色で表示される。円形のス ポットでは、赤色で表示された円形の蛍光像が観察でき、また、正方形のスポッ トでは、赤色で表示された正方形の蛍光像が観察できた。また、これらの蛍光像 を、緑色で表示された反射像と重ね合わせたところ、蛍光像のスポットの形と一 致したことから、DNAスタンプ溶液が、基板上の突出スポット部頂上のスポッ ト用平面のみにスタンピングされたことが証明された。このように、本発明の基 板によれば、反射像により、基板上の突出スポット部頂上のスポット用平面の位 置および大きさを認識し、DNAがスタンプされた領域を特定することができる



なお、本実施例で使用したスキャナーの反射用の焦点深度は 500μ mであったため、突出スポット部周辺の基板表面(突出スポット部頂上のスポット平面との高低差: 50μ m)からの反射光も、スポット平面からの反射光とほぼ同様の強度で検出された。但し、本実施例では、突出スポット部周辺の基板表面と、突出スポット部側面とのなす角が、110度であったため、反射像で、側面部に相当する部分が黒い縁取りとして表れることにより、スポットの位置および大きさを特定することができた。

[0058]

実施例3

電気泳動によるハイブリダイゼーションの促進効果の検証 (直流電荷)

実施例1で得られた核酸マイクロアレイ用基板の突出スポット部頂上のスポット用平面に、チオール化DNAプローブ (tatgacaatg aatacggcta cagcaacagg gtgg tggacc tcatg(配列番号2)、遺伝子名GAPDH) を固定化し、蛍光標識マウス脳 c R N A をターゲットとしてハイブリダイゼーションを行った。

図7に示す蛍光と反射光とを同時に計測することができるDNAマイクロアレイスキャナーによって、このマイクロアレイを観察した結果、図10に示すように、電荷をかけたもの(c)では、電荷をかけなかったもの(b)に比べ明らかに高い蛍光シグナルが得られ、電気泳動により、ハイブリダイゼーションの促進効果があることが明らかとなった。またこの蛍光像を、反射像(a)と重ね合わ



せれば、ハイブリダイゼーションの生じたスポットを特定することができる。 【0059】

実施例4

誘電泳動によるハイブリダイゼーションの促進効果の検証(交流電荷)

実施例1で得られた核酸マイクロアレイ用基板の突出スポット部頂上のスポッ ト用平面に、5種類のDNAプローブ(配列番号3:ggccgttctgcttacagtggcttgcag agcagctcctacttgatg·遺伝子名NFL、配列番号4:gtaccaacattgcctcctagcagagaa gtgtgtgtgtgtgagaagcc·遺伝子名Ubiquitin2e、配列番号5:ttttgtccccccaacttga tgtatgaaggctttggtctccctggg 遺伝子名 β -actin、配列番号 6 : gcagtggcaaagtggagattgttgccatcaacgaccccttcattg 遺伝子名gapdh、配列番号 7:agccaggaaatttg tcgagagcgcagccacttctttcagtgttgc 遺伝子名psbP) を末端固定し、5'蛍光Cy3標 識した各相補オリゴDNAをターゲットとしてハイブリダイゼーションを行った 。ハイブリダイゼーション溶液は50mMヒスチジンとし、各相補鎖オリゴDNAの最終 ターゲット濃度を、配列番号3のDNAプローブについては0.001μM、配列番号 4のDNAプローブについては0.01μM、配列番号5のDNAプローブについて は0.1μM、配列番号6のDNAプローブについては1μM、配列番号7のDNAプ ローブについては0μM(無添加)として調製混合した。マイクロアレイと対向金 電極を向かい合うようにし、その間に絶縁のために0.03㎜のゴムシートをはさみ 、マイクロアレイと電極とをクリップにより固定した。0.03mmの空間に上記ター ゲットを有するハイブリダイゼーション溶液を入れ、マイクロアレイと対向金電 極とを、電源・発振器につなぎ、1MHz、0.2MV/mの交流電荷を2分間かけた。図 7に示す蛍光と反射光とを同時に計測することができるDNAマイクロアレイス キャナーによって、このマイクロアレイを観察した結果、図11に示すように、 電荷をかけたもの(a)では、電荷をかけなかったもの(b)に比べ明らかに高 い蛍光シグナルが得られた。ターゲット濃度と蛍光強度との相関を、図12に示 す。図11および図12より、マイクロアレイと対向電極との間に交流電荷を印 加することによって、誘電泳動によるハイブリダイゼーションの促進効果が得ら れることがわかる。また、本実施例で、ターゲット濃度に依存した蛍光シグナル が得られていること、および、ネガティブコントロールでシグナルが検出されな



かったことから、蛍光強度により、ハイブリダイゼーションの程度を測定することができることがわかる。また、図11(a)の蛍光像を、図11(c)の反射像と重ね合わせれば、ハイブリダイゼーションの生じたスポットを特定することができる。

[0060]

【発明の効果】

本発明によれば、生体分子マイクロアレイに一定形状の生体分子固定化領域を持つ基板及び生体分子の相互作用、特にハイブリダイゼーションを高速に行い、かつ微量サンプルの相互作用を促進させ、さらに高速・高感度に相互作用を検出し解析する手段を提供することができる。

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> RIKEN

<120> Substrate for biomolecule microarray, biomolecule microarray, device and method for accelerating interaction and detecting method of interaction

<130> A35048H

<160> 7

<210> 1

<211> 45

<212> DNA

<213> GAPDH

<400> 1

tatgacaatg aatacggcta cagcaacagg gtggtggacc tcatg 45

<210> 2

<211> 45

<212> DNA

<213> GAPDH



<400> 2

tatgacaatg aatacggcta cagcaacagg gtggtggacc tcatg 45

<210> 3

<211> 45

<212> DNA

<213> NFL

<400> 3

ggccgttctg cttacagtgg cttgcagagc agctcctact tgatg 45

<210> 4

<211> 45

<212> DNA

<213> Ubiquitin2e

<400> 4

gtaccaacat tgcctcctag cagagaagtg tgtgtgtgag aagcc 45

<210> 5

<211> 45

<212> DNA

 $\langle 213 \rangle$ β -actin

<400> 5

ttttgtcccc ccaacttgat gtatgaaggc tttggtctcc ctggg 45

<210> 6

<211> 45

<212> DNA

<213> gapdh

<400> 6

gcagtggcaa agtggagatt gttgccatca acgacccctt cattg 45

<210> 7

<211> 45

<212> DNA



<213> psbP

<400> 7

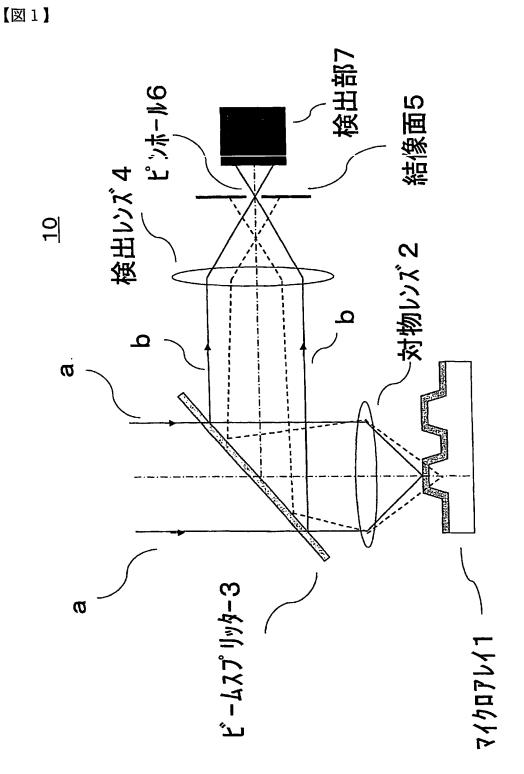
agccaggaaa tttgtcgaga gcgcagccac ttctttcagt gttgc 45

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明で使用される共焦点型検出器の光学系の概略図である。
- 【図2】本発明の基板上の突出スポット部の概略図である。
- 【図3】本発明の基板の粗面化されたスポット用平面の一例(部分拡大図)を示す。
 - 【図4】略V字型底面を有する基板の一部の拡大図を示す。
 - 【図5】本発明の第二の態様の基板の一例を示す。
 - 【図6】本発明の生体分子の相互作用促進用装置の概略図を示す。
- 【図7】反射光と蛍光とを同時に検出することができる共焦点型スキャナーの光 学系の概略図を示す。
- 【図8】実施例1で作製した基板のデジタルカメラ像および共焦点顕微鏡像である。
- 【図9】実施例2で得られた蛍光像(a)、反射像(b)、および、蛍光像と反射像とを重ね合わせた像(c)である。
 - 【図10】実施例3で得られた反射像および蛍光像である。
 - 【図11】実施例4で得られた反射像および蛍光像である。
- 【図12】実施例4におけるターゲット濃度と蛍光強度との相関を示すグラフである。

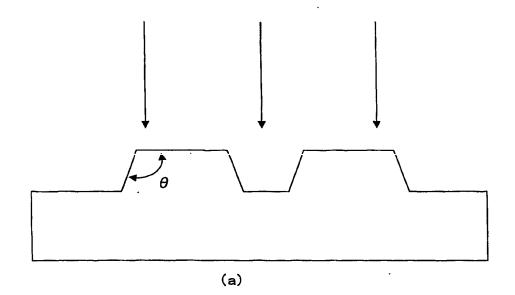


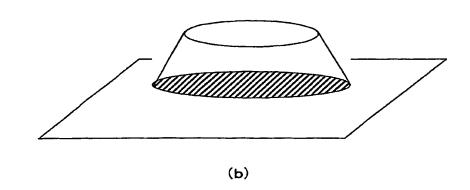
【書類名】 図面





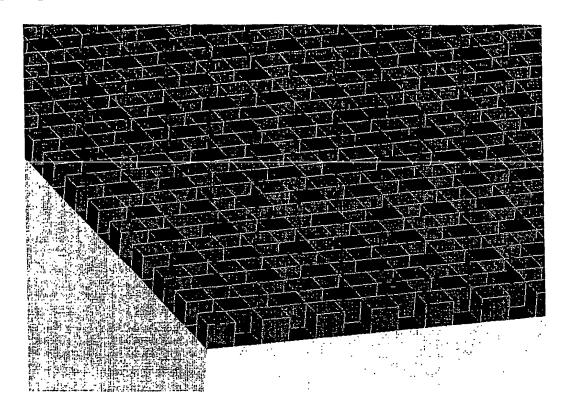
【図2】





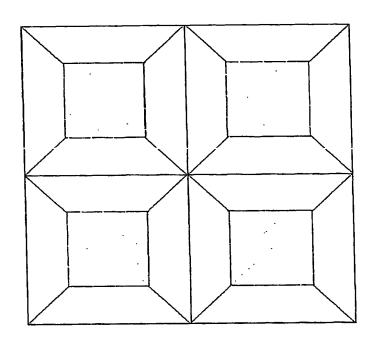


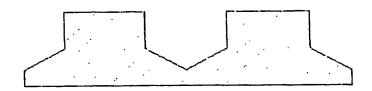
【図3】





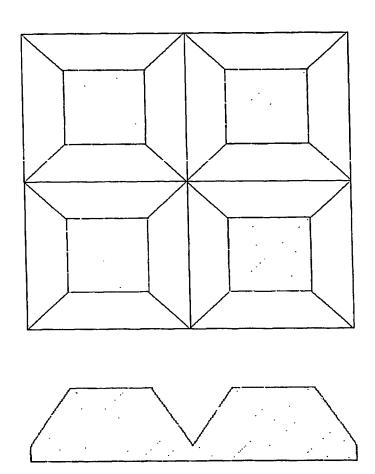
【図4】





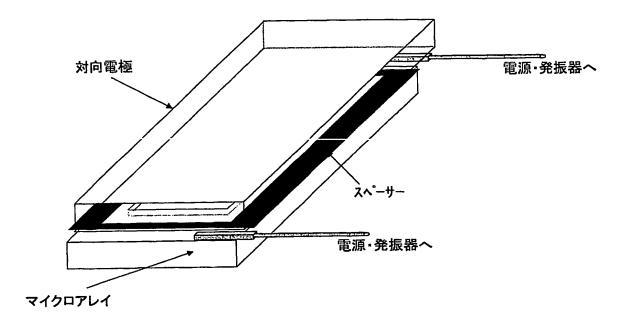


【図5】

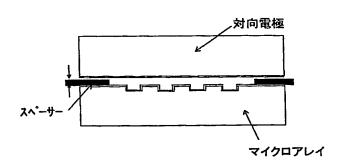




【図6】



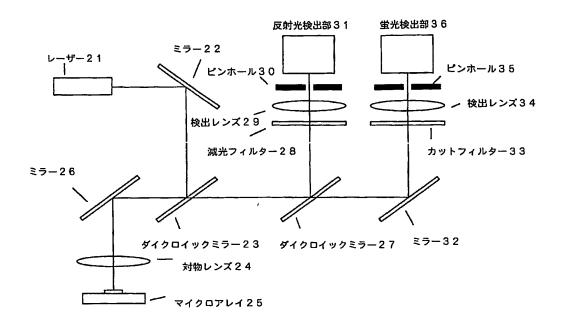
(a)



(b)

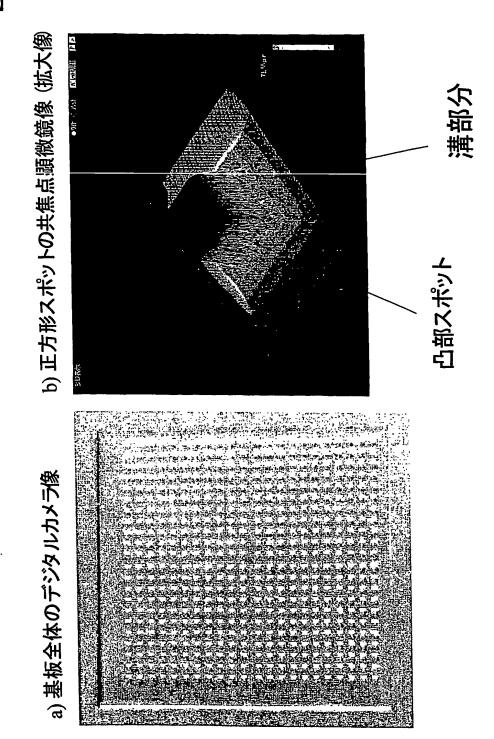


【図7】



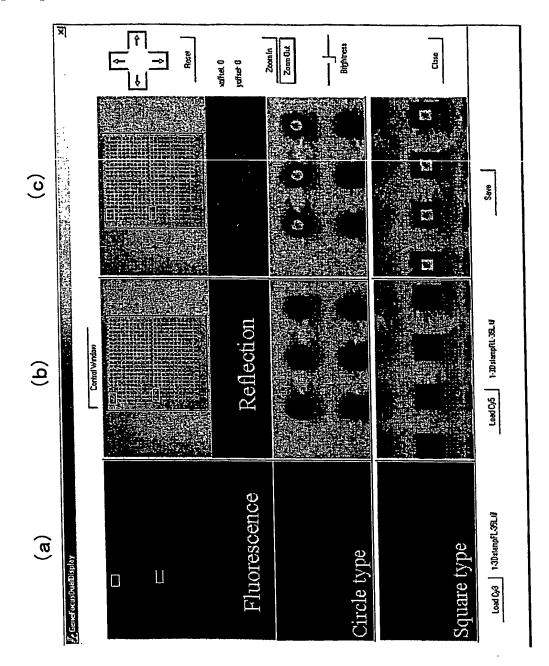


【図8】



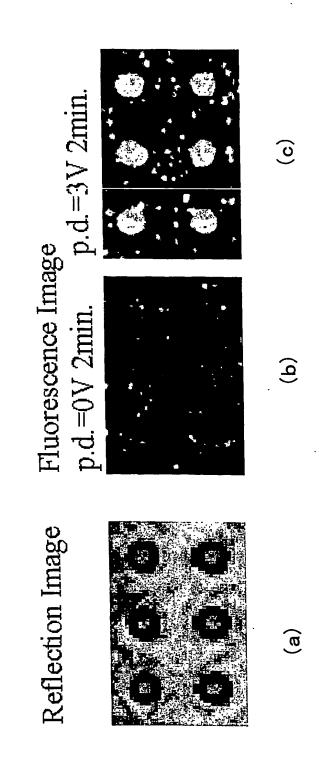


【図9】



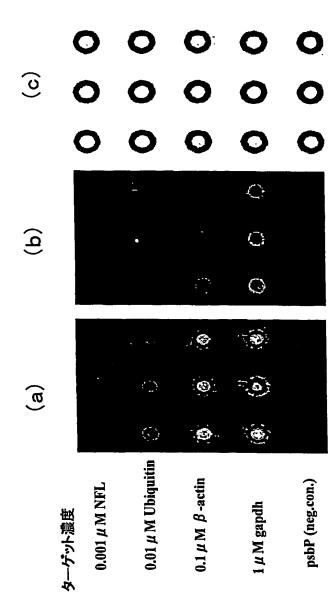


【図10】



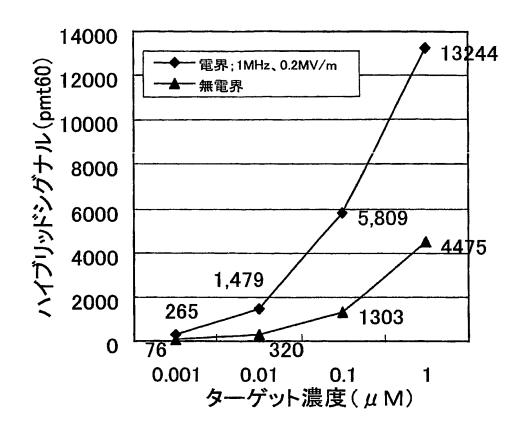


【図11】





【図12】







【書類名】要約書

【要約】

【課題】生体分子マイクロアレイに一定形状の生体分子固定化領域をもつ基板及 び生体分子の相互作用を高速に行い、かつ微量サンプルの相互作用を促進させ、 さらに高速・高感度に相互作用を検出し解析する手段を提供すること。

【解決手段】基板表面に、生体分子固定化用スポットを1つ以上有する生体分子マイクロアレイ用基板。前記生体分子固定化用スポットは、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有し、かつ少なくとも、前記突出スポット部周辺の基板表面、突出スポット部側面、およびスポット用平面は、導電性物質からなるか、または、基板表面から突出し、かつ頂上にスポット用平面を有し、隣り合う突出スポット部は、突出スポット部側面によって隣接しており、かつ少なくとも、前記突出スポット部側面およびスポット用平面は、導電性物質からなる。前記基板および生体分子を含み、生体分子は、前記基板上の少なくともスポット用平面に固定化されている生体分子マイクロアレイ。基板上に1つ以上の生体分子固定化スポットを有する生体分子マイクロアレイ、前記マイクロアレイの生体分子固定化スポットを有する面に対向するように設けられた電極、および前記マイクロアレイと前記電極との間に電界を印加するための電源を有する生体分子の相互作用促進用装置。前記装置を用いる生体分子の相互作用促進方法。生体分子相互作用の検出方法。

【選択図】なし

1/E



【書類名】 出願人名義変更届(一般承継)

【提出日】平成15年12月 1日【あて先】特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003-170051

【承継人】

【識別番号】 503359821

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 【氏名又は名称】 独立行政法人理化学研究所

【承継人代理人】

【識別番号】 100075812

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉武 賢次

【提出物件の目録】

【物件名】 権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】 登記簿謄本 1

【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】 委任状 1



委任状

【添付書類】 紅海

委 任 状



私は、

識別番号 100075812 弁理士 吉 武 賢 次 氏 を代理人と定めて下記事項を委任する。

- 9545年 別紙目録に記載の特許出題に関する出願人名義変更届をする件
- 2. 上記各項の手続を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以上

平成 / 5 年 // 月 / 9 日

代表 者 理事長野 依良



目録(1)

```
1.
   特顧昭63-235737
                          51.
                              特願平07-327372
2.
   特願平05-044143
                          52.
                              特願平08-000652
3.
   特願平05-127257
                          53.
                              特顯平08-026368
4.
   特願平05-127258
                          54.
                              特願平08-030850
5.
   特願平05-213675
                          55.
                              特願平08-041279
6.
                          56.
   特願平05-306164
                              特願平08-045903
7.
   特願平05-328611
                          57.
                              特顯平08-051604
8.
   特願平05-336746
                          58.
                              特願平08-065715
9.
   特顯平08-035100
                          бэ̂.
                              特顯平 Ū 8 一 U 7 O O 7 1
   特願平06-061792
10.
                          60.
                              特願平08-105667
11.
   特顯平06-061793
                          61.
                              特願平08-107784
12.
   特願平06-069150
                          62.
                              特願平08-116473
13.
    特願平06-097098
                          63.
                              特願平08-123475
14.
   特願平06-111624
                          64.
                              特願平08-127005
15.
    特願平06-121100
                          65.
                              特顯平08-131746
16.
    特願平06-145908
                          66.
                              特願平08-132846
17.
    特願平06-158670
                          67.
                              特顯平08-132854
18.
    特願平06-158671
                          68.
                              特願平08-142676
19.
    特願平06-165751
                          69.
                              特顯平08-158078
20.
    特顧平06-165752
                          70.
                              特願平08-167401
21.
    特願平06-181857
                          71.
                              特願平08-196331
22.
    特願平06-235742
                          72.
                              特願平08-197050
23.
    特願平06-238603
                          73.
                              特願平08-197051
24.
    特願平06-244764
                          74.
                              特願平08-211946
25.
    特願平06-248486
                          75.
                              特願平08-216506
26.
    特願平06-252942
                          76.
                              特願平08-216508
27.
    特顧平06-268723
                          77.
                              特願平08-222352
28.
    特顯平06-293933
                          78.
                              特顯平08-231066
29.
    特願平06-301372
                          79.
                              特願平08-233442
30.
    特願平06-323795
                          80.
                              特顯平08-236685
31.
    特願平06-324490
                          81.
                              特願平08-251410
32.
    特願平06-507966(スタル2002-12420)82.
                              特願平08-262051
33.
    特顯平07-007185
                          83.
                              特願平08-302896
                              特顧平08-308335
34.
    特願平07-069255
                          84.
                              特願平08-308336
35:
    特顯平07-082880
                          85.
36.
    特願平07-083142
                              特願平08-311467
                          86.
37.
    特願平07-117933
                          87.
                              特願平08-315093
38.
    特願平07-133487
                          88.
                              特顧平08-317622
39.
    特願平07-205141
                          89.
                              特顧平08-320241
40.
    特願平07-214659
                          90.
                              特願平08-506395
41.
    特願平07-217276
                          91.
                              特願平09-002295
42.
    特願平07-236185
                          92.
                              特願平0.9~010602
    特顧平07-240684
43.
                          93.
                              特願平09-019968
    特願平07-249244
44.
                              特顯平09-019969
                          94.
45.
    特顯平07-259922
                          95.
                              特顯平09-019971
46.
    特願平07-282716
                          96.
                              特願平09-024890
47.
    特願平07-302793
                          97.
                              特願平09-028982
48.
    特願平07-306004
                          98.
                              特願平09-046824
49.
    特額平07-311711
                          99.
                              特願平09-049254
50.
                           100. 特顯平09-053478
    特顧平07-311715
```



目録(2)

101.	特願平09-054595	151. 特願平10-045434
102.	特願平09-056654	152. 特願平10-049499
103.	特願平09-057342	153. 特願平10-049867
104.	特願平09-058774	154. 特願平10-051489
105.	特願平09-067611	155. 特願平10-051490
106.	特顧平09-074394	156. 特願平10-051491
107.	特顧平09-080480	157. 特願平10-051492
108.	特願平09-082965	158. 特願平10-051493
109.	特顧平09-091523	159. 特顯平10-080740
110.	特願平09-091591	160. 特願平10-060741
111.	特願平09-091694	161. 特願平10-061895
112.	特願平09-098988	162. 特顯平10-078139
113.	特願平09-099061	163. 特願平10-085207
114.	特願平09-099109	164. 特願平10-085208
115.	特願平09-104093	165. 特願平10-103083
116.	特願平09-119730	166. 特願平10-103115
117.	特願平09-129068	167. 特願平10-103671
118.	特願平09-134525	168. 特願平10-104093
119.	特願平09-147964	169. 特顯平10-113493
120.	特顯平09-155364	170. 特願平10-116378
121.	特願平09-159963	171. 特願平10-121456
122.	特願平09-163630	172. 特願平10-127520
123.	特願平09-163631	173. 特願平10-136198
124.	特願平09-171924	174. 特願平10-149603
125.	特顯平09-175896	175. 特願平10-150494
126.	特願平09-180423	176. 特願平10-151245
127.	特願平09-189436	177. 特願平10-155838
128.	特願平09-198201	178. 特願平10-155841
129.	特願平09-208866	179. 特願平10-156104
130.	特願平09-221067	180. 特願平10-156108
131.	特願平09-228345	181. 特願平10-198313
132.	特願平09-230870	182. 特願平10-200280
133.	特願平09-253740	183. 特願平10-217132
13 4. 135.	特願平09-256795 特願平09-271782	184. 特願平10-217180
136.	特願平09-291995	185. 特願平10-222837
137.	特願平09-297084	186. 特顯平10-227939
138.	特願平09-307627	187. 特願平10-229591
139.	特願平09-308597	188. 特顯平10-232520 189. 特顯平10-232590
140.	特願平09-309848	
141.		100000
142.	特願平09-327609	
143.	特願平09-328742	
144.	特願平09-326742	193. 特顧平10-245293
145.	特願平10-002030	194. 特顯平 1 0 - 2 5 0 5 9 8 195. 特顯平 1 0 - 2 5 0 6 1 1
146.	特願平10-002030	
147.		
148.		
149.		198. 特願平10-260416 199. 特願平10-268791
150.		
TOU.	C C C C P U - U A T PRANT	200. 特願平10-269859



目録(3)

			44-14-4-1-4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
201.	特顧平10-272529	251.	特願平11-135137
202.	特願平10-280351	252.	特顯平11-135482
203.	特願平10-308533	253.	特願平11-143429
204.	特願平10-309765	254.	特願平11-144005
205.	特願平10-311673	255.	特願平11-147097
206.	特願平10-311674	256.	特顯平11-151099
207.	特願平10-311675	257.	特顯平11-166247
208.	特願平10-314856		
		258.	特顯平11-173839
209.	特顯平 1 0 — 3 1 5 7 5 1	259.	特顯平11-179278
210.	特願平10-338896	260.	特願平11-186052
211.	特願平10-338897	261.	特願平11-193235
212.	特願平10-338898	262.	特願平11-224269
213.	特願平10-338899	263.	特顯平11-225060
214.	特願平10-352428	264.	特願平11-225832
215.	特願平10-354665	265.	特願平11-225839
216.	特願平10-363297	266.	特願平11-226176
217.	特願平10-363329	267.	特願平11-234800
218.	特願平10-506788	268.	特願平11-240325
219.	特願平10-532832	269.	特顯平11-24.0910
220.	特願平10-535583	270.	特願平11-241737
221.	特願平11-008183	271.	特願平11-242438
222.	特願平11-013380	272.	特顧平11-242490
223.	特願平11-015176	273.	特願平11-253851
224.	特願平11-013170 特願平11-031724	274.	特願平11-250947
225.	特願平11-031724	275.	
226.	特顯平11-035776	276.	特願平11-277759
227.			特顯平11-278976
228.	特願平11-055835	277. 278.	特顯平11-279324
	特願平11-055867		特願平11-281632
229.	特願平11-055930	279.	特願平11-303976
230.	特顯平11-056957	280.	特顯平11-309616
231.	特願平11-057381	281.	特顧平11-315036
232.	特顯平11-057749	282.	特顯平11-321282
233.	特顯平11-058103	283.	特願平11-336079
234.	特願平11-061079	284.	特願平11-346467
235.	特願平11-061080	285.	特願平11-354563
236.	特顯平11-064193	286.	特願平11-360274
237.	特顯平11-064372	287.	特願平11-365899
238.	特願平11-064506	288.	特願平11-373483
239.	特願平11-065136	289.	特願平11-510791
240.	特願平11-074385	290.	特顯平11-515324
241.		291.	
242.	特顯平11-090383	292.	特顧2000-005221
243.	特願平11-091875	293.	特願2000-009363
244.		294.	特顧2000-010516
245.		295.	特顧2000-011147
246.		296.	特願2000-011623
247.		297.	特願2000-016518
248.	特願平11-130771	298.	特願2000-016622
249.		299.	特願2000-017112
250.		300.	特願2000-018612



目録(4)

301.	特願2000-019195	351.	MAKETO O O O O O O O O
			特願2000-141763
302.	特願2000~019528		特願2000-148843
303.	特願2000-020067	353.	特願2000-152455
304.	特願2000-030321	354.	特顯2000-152469
305.	特願2000-034109	355.	特願2000-154484
306.	特願2000-039082	, 356.	特顧2000-161895
307.	特願2000-040355	357.	特願2000-163122
308.	特願2000-041927	358.	特願2000-164584
309.	特願2000-041929	359.	特顧2000-179723
310.	特願2000-045318	360.	特願2000-181281
311.	特顧2000-045855	361.	特願2000-184259
312.	特願2000-051488	362.	特願2000-184295
313.	特顯2000-051650	363.	特願2000-191007
314.	特顧2000-052040	364.	特顧2000-191265
315.	特願2000-053707	365.	特願2000-192332
316.	特願2000-054949	366.	特願2000-193817
317.	特願2000-056093	367.	特願2000-195384
318.	特願2000-056879	368.	特願2000-196991
319.	特願2000-057564	369.	特顧2000-197022
320.	特顧2000-057565	370.	特願2000-202801
321.	特顧2000-057566	371.	特願2000-216457
322.	特顧2000-058133	372.	特願2000-223714
323.	特顧2000-058282	373.	特願2000-224970
324.	特顧2000-062316	374.	特願2000-225486
325.	特顧2000-064142	375.	特顯2000-225864
326.	特願2000-064209	376.	特顯2000-225978
327.	特顧2000-071119	377.	特願2000-226361
328.	特顧2000-076122	378.	特願2000-229191
329.	特顧2000-085874	379.	特顧2000-230551
330.	特願2000-089078	380.	特願2000-237165
331.	特顧2000-092693	381.	特顯2000-237166
332.	特願2000-100395	382.	特願2000-237533
333.	特願2000-105139	383.	特願2000-246309
334.	特顧2000-105917	384.	特願2000-248331
335.	特顧2000-107160	385.	特願2000-249232
336.	特願2000-108409	386.	特願2000-256149
337.	特願2000-109638	387.	特願2000-257080
338.	特願2000-109954	388.	特顯2000-257083
339.	特願2000-118361	389.	特願2000-260030
340.	特願2000-120874	390.	特顧2000-261233
341.		391.	
342.		392.	特願2000-265344
343.		393.	特願2000-278502
344.		394.	特顯2000-279557
345.		395.	特願2000-219557
346.		396.	特顯2000-292422
347.		397.	
348.		398.	特願2000-299812
349.		399.	特願2000-307464
350.		400.	特願2000-308248
ouv.	O D D I T I C O O O O REDE	4 00.	特願2000-309581



目録(5)

404	##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	APA AMERICA DA A DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL CO
401.	特願2000-319775	451. 特願2001-071435
402.	特願2000-322056	452. 特顯2001-072650
403.	特願2000-333311	453. 特願2001-072668
404.	特顧2000-334686	454. 特願2001-072963
405.	特願2000-334969	455. 特願2001-073028
406.	特願2000-343912	456. 特願2001-074964
407.	特願2000-347398	457. 特願2001-074965
408.	特願2000-347865	458. 特顧2001-077257
409.	特願2000-358121	
410.	特願2000-368566	
411.	特願2000-374626	
412.	特顧2000-375090	
413.	特顧2000-378421	
414.		463. 特願2001-092337
414.	特願2000-378942	464. 特願2001-116171
	特願2000-378950	465. 特願2001-124294
416.	特顯2000-384771	466. 特願2001-124452
417.	特願2000-387016	467. 特願2001-127575
418.	特願2000-394815	468. 特願2001-127576
419.	特願2000-396445	469. 特顯2001-135357
420.	特願2000-399940	470. 特願2001-137087
421.	特願2000-400336	471. 特願2001-138103
422.	特願2000-401110	472. 特願2001-142583
423.	特願2000-401245	473. 特顯2001-147081
424.	特願2000-401258	474. 特願2001-152364
425.	特願2000-503838	475. 特願2001-152379
426.	特願2000-571733	476. 特顧2001-153447
427.	特願2000-571943	477. 特願2001-155572
428.	特願2000-602588	478. 特願2001-163740
429.	特顯2000-602900	479. 特願2001-164819
430.	特顧2000-618709	480. 特願2001-164997
431.	特顧2001-003476	481. 特願2001-165133
432.	特顧2001-005615	482. 特願2001-167910
433.	特願2001-007979	483. 特願2001-168784
434.	特願2001-016626	484. 特願2001-171705
435.	特願2001-025030	485. 特願2001-173331
436.	特願2001-037141	486. 特願2001-174421
437.	特願2001-037147	487. 特願2001-174553
438.	特願2001-042501	488. 特顧2001-175898
439.	特顧2001-044933	489. 特願2001-178169
440.	特願2001-047762	490. 特顧2001-179858
441.	特願2001-050845	491. 特願2001-180552
442.	特願2001-053550	492. 特願2001-180554
443.	特願2001-054717	493. 特願2001-187735
444.	特願2001-059115	494. 特願2001-197185
445.		495. 特願2001-197897
446.		496. 特顧2001-200854
447.		497. 特顧2001-201356
448.		498. 特顧2001-201336
449.	·	499. 特願2001-202971
450.		500. 特願2001-203089
700.	73,00,000	000. THERE OUT - 200505



目録(6)

501.	特願2001-206522	551. 特顧2001-325367
502.	特願2001-206523	552. 特願2001-326872
503.	特願2001-209305	553. 特願2001-327853
504.	特願2001-212947	554. 特顧2001-329023
505.	特願2001-216505	555. 特顧2001-332168
506.	特願2001-220219	556. 特顧2001-337467
507.	特顧2001-226176	557. 特願2001-339396
508.	特願2001-228287	558. 特願2001-339593
509.	特顧2001-228374	559. 特願2001—339393
510.	特顧2001-235412	560. 特顯2001-347316
511.	特顧2001-235747	561. 特顧2001-347637
512.	特顧2001-238951	562. 特顧2001-349614
513.	特顧2001-241023	563. 特願2001-351730
514.	特顧2001-243930	564. 特顧2001-352189
515.	特願2001-246642	565. 特願2001-353038
516.	特願2001-249976	566. 特顧2001-358446
517.	特願2001-254377	567. 特願2001-358581
518.	特顧2001-254378	568. 特願2001-359710
519.	特願2001-255589	569. 特顧2001-374928
520.	特願2001-256576	570. 特顧2001-376591
521.	特願2001-257188	571. 特願2001-378757
522.	特願2001-261158	572. 特顧2001-380473
523.	特願2001-266004	573. 特願2001-382537
524.	特願2001-266069	574. 特願2001-382539
525.	特願2001-266454	575. 特願2001-382599
526.	特願2001-267194	576. 特願2001-385258
527.	特願2001-267379	577. 待願2001-385512
528.	特顧2001-267863	578. 特顯2001-385513
529.	特願2001-272977	579. 特顯2001-385538
530.	特願2001-273964	580. 特顯2001-388116
531.	特願2001-276053	581. 特顯2001-390122
532.	特願2001-279406	582. 特顧2001-392087
533.	特願2001-280319	583. 特願2001-392088
534.	特顯2001-285145	584. 特願2001-395196
535.	特顯2001-291059	585. 特願2001-396120
536. 537.	特願2001-292223	586. 特願2001-397762
538.	特願2001-292224	587. 特願2001-397998
539.	特願2001-293000	588. 特願2001-401139
540.	特願2001-293054 特願2001-293936	589. 特顧2001-515803
541.	特願2001-293936	590、特顧2001-523852
542.		591. 特顧2001-557672
543.	特願2001-298140	592. 特顧2002-000993
544.	特願2001-298402 特願2001-307340	593. 特顧2002-005746
545.	特願2001-307340	594. 特顧2002-010344
546.	特願2001-309501 特願2001-309508	595. 特願2002-011558
547.	特願2001-309908	596. 特顯2002-019752
548.		597. 特願2002-020329
549.	特願2001-310554 特顧2001-313430	598. 特顧2002-022499
550.	特顧2001-313430	599. 特願2002-028046
ouu.	148K 7 0 0 7 - 3 1 8 3 0 0	600. 特顧2002-028109

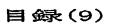


601.	特願2002-040151	651. 特	顧2002-162157
602.	特願2002-042829		顧2002-162211
603.	特顧2002-044340		顧2002-162365
604.	特願2002-044640		顧2002-162365
605.	特顧2002-046188		
606.	特願2002-040188		願2002-170068
607.	特願2002-053190		願2002-170902
			願2002-176435
608.	特願2002-053575		願2002-176583
609.	特願2002-055272		願2002-183722
610.	特願2002-057253		願2002-185966
611. 612.	特願2002-057565		願2002-187362
	特願2002-057935		顧2002-187957
613.	特願2002-057963	and the second s	顧2002-188281
614.	特願2002-066249		願2002-189265
615.	特顯2002-070624		顧2002-194627
616.	特願2002-070987		顧2002-197812
617.	特願2002-071924		願2002-201443
618.	特願2002-074902		顧2002-201575
619.	特顯2002-078164		瀬2002-202118
620. 621.	特願2002-081467		欄2002-205814
	特願2002-081502		類2002-205825
622. 623.	特願2002-083081 特願2002-084139		題2002-217714
624.	特顧2002-084139	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	題2002-221188
625.	特願2002-087342		類2002-225469
626.	特願2002-087342		特願2002-225724 特顧2002-226859
627.	特願2002-095132		時期2002—220859
628.	特願2002-095389		時顧2002—227286
629.	特願2002-100431	-	持顧2002—229006
630.	特願2002-106561		時顧2002—235294
631.	特願2002-119320		時顧2002—23528 年
632.	特顧2002-120371		時顧2002-236838
633.	特願2002-123347		持顧2002-237058
634.			韓顧2002-237092
635.		-	寺願2002-248946
636.	* *		寺顧2002-253322
637.			寺顧2002-253689
638.	特願2002-141187		寺願2002-253697
639.			寺顧2002-254096
640.			寺顧2002-257924
641.	特願2002-149471		時順2002-260788
642.			時顧2002-261499
643.			诗願2002-264969
644.			诗願2002-267114
645.			持願2002—268987
646.			持顧2002-270917
647.		697.	時顧2002-271375
648.			時顧2002-271473
649.			持願2002-273996
650	* * **		持願2002-274469

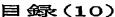


目録(8)

701.	特願2002-276051	751. 特願2003-012738
702.	特願2002-282746	752. 特顧2003-012774
703.	特願2002-286487	753. 特願2003-015968
704.	特願2002-289209	754. 特願2003-016044
705.	特願2002-295332	755. 特顯2003-016940
706.	特願2002-296911	756. 特顧2003-017397
707.	特願2002-299429	
708.	特願2002-301875	
709.	特願2002-303838	
710.	特願2002-303838	
711.		760. 特願2003-025277
712.	特願2002-320102	761. 特願2003-027647
713.	特願2002-320704	762. 特願2003-027648
	特願2002-325909	763. 特願2003-031882
714.	特顯2002-325920	764. 特顧2003-032932
715.	特願2002-332232	765. 特願2003-038206
716.	特願2002-339344	766. 特願2003-040642
717.	特願2002-339392	767. 特願2003-043961
718.	特願2002-339541	768. 特願2003-050153
719.	特願2002-339551	769. 特願2003-050446
720.	特願2002-341195	770. 特顧2003-052520
721.	特願2002-343807	771. 特顧2003-052602
722.	特願2002-344279	772. 特顧2003-052613
723.	特顧2002-345597	773. 特顧2003~052877
724.	特願2002-347401	774. 特願2003-053023
725.	特顯2002-348760	775. 特願2003-054182
726.	特願2002-349042	776. 特願2003-054798
727.	特願2002-354594	777. 特願2003-054799
728.	特願2002-357768	778. 特願2003-054846
729.	特願2002-357900	779. 特顧2003-054847
730.	特願2002-358019	780. 特願2003-054848
731.	特願2002-358967	781. 特顧2003-054849
732.	特顯2002-360972	782. 特願2003-055452
733.	特願2002-360975	783. 特願2003-056628
734.	特願2002-368112	784. 特願2003-061426
735.	特願2002-376555	785. 特願2003-063532
736.	特願2002-376774	786. 特顧2003-065013
737.	特願2002-376831	787. 特顧2003-071028
738.	特願2002-379214	788. 特顧2003-072979
739.	特願2002-380624	789. 特願2003-074168
740.	特願2002-381888	790. 特顧2003-076107
741.	特願2002-382170	791. 特顧2003-078999
742.	特願2002~383870	792. 特顯2003-079598
743.	特願2002-521644	793. 特願 2 0 0 3 - 0 7 9 6 1 3
744.	特願2002-532458	794. 特願2003-082466
745.	特願2002-548584	795. 特顧2003-083318
746.	特願2002-548185	796. 特願2003-083433
747.	特願2002-570743	797. 特顧2003-083480
748.	特顧2003-003450	798. 特顧2003-085193
749.	特願2003-012550	799. 特顧2003-089026
750.	特顧2003-012694	800. 特願2003-089026
•		000. TREAT 003 - U 8 U 3 3 I



801.	特願2003-091446	851. 待願2003-127135
802.	特願2003-092654	852. 特願2003-127150
803.	特願2003-093642	853. 待願2003-128818
804.	特願2003-094272	854. 特願2003-128897
805.	特願2003-094719	855. 特願2003-129347
806.	特願2003-095770	856. 特願2003-131313
807.	特願2003-095884	857. 特顧2003-132280
808.	特願2003-095885	858. 特願2003-132605
809.	特願2003-095886	859. 特願2003-132606
810.	特願2003-095904	860. 特願2003-135591
811.	特願2003-097283	861. 特願2003-138445
812.	特願2003-097327	862. 特願2003-139397
813.	特願2003-101917	863. 特願2003-140684
814.	特願2003-104928	864. 特願2003-142303
815.	特願2003-105362	865. 特願2003-143932
816.	特願2003-107267	866. 特願2003-145221
817.	特願2003-107268	867. 特願2003-145390
818.	特願2003-107647	868. 特願2003-147820
819.	特願2003-107885	869. 特顧2003-150690
820.	特願2003-109575	870. 特顧2003-153014
821.	特願2003-115750	871. 特顧2003-153015
822.	特願2003-115793	872. 特顧2003-153016
823.	特願2003-115847	873. 特顧2003-153985
824.	特願2003-115888	874. 特顯2003-154009
825.	特願2003-116232	875. 特顧2003-154841
826.	特願2003-116895	876. 特顧2003-155397
827.	特願2003-118161	877. 特顧2003-155407
828.	特願2003-118186	878. 特願2003-158017
829.	特願2003-119749	879. 特願2003-161005
830.	特願2003-119930	880. 特願2003-164126
831.	特願2003-120934	881. 特顧2003-170051
832.	特願2003-121233	882. 特願2003-170324
833.	特願2003-121261	883. 特顧2003-170325
834.		884、特顯2003-170326
835.		885. 特顧2003-170327 886. 特顧2003-170328
836.		886. 特願2003-170328 887. 特願2003-170329
837.		
838.		888. 特願2003-170330 889. 特願2003-170573
839. 840.		890. 特顧2003-170373
		891. 特顧2003-171619
841. 842.		892. 特願2003-171019
843		893. 特顧2003-175819
844		894. 特顯2003-177298
845		895. 特顧2003-180198
846		896. 特顧2003-182958
847		897. 特顧2003-182988
848		898. 特顧2003-192775
849		899. 特顧2003-192778
850		900. 特顧2003-194637
000	. JONNE COO IZIIZO	0000 70mx 2000 101228



```
特願2003-198340
902.
   特願2003-204075
903.
   特願2003-205349
904.
   特願2003-205710
905.
   特願2003-206546
906.
   特願2003-207698
907.
   特願2003-207771
908.
   特願2003-207772
909.
   特願2003-207850
910.
   特願2003-270049
911.
   特願2003-271473
912.
   特願2003-272421
913.
   特願2003-275055
914.
   特顧2003-277958
   特願2003-279130
915.
   特願2003-283972
916.
917.
    特願2003-284055
918.
   特願2003-286640
919.
    特願2003-289138
920.
    特願2003-293912
    特願2003-296474
921.
922.
    特願2003-298558
923.
    特願2003-299424
924.
    特願2003-303979
925.
    特願2003-304452
926.
    特願2003-304453
927.
    特願2003-305689
    特顧2003-305844
928.
929.
    特願2003-306137
    特願2003-307564
930.
    特額2003-313014
931.
    特額2003-315355
932.
    特願2003-318801
933.
934.
    特願2003-321497
935.
    特願2003-322948
936.
    特顧2003-324974
937.
    特願2003-326510
938.
    特顯2003-327645
939.
    特願2003-327907
940.
    特願2003-328600
941.
    特願2003-328840
942.
    特願2003-330418
943.
    特願2003-330569
944.
    特願2003-331848
    特顯2003-332756
945.
946.
    特願2003-333798
 947.
    特願2003-333932
    特願2003-334036
 948.
    特顧2003-334083
 949.
 950.
    特願2003-336365
```

951. 特願 2 0 0 3 — 3 3 8 1 9 1 952. 特願 2 0 0 3 — 3 3 9 5 4 2 953. 特願 2 0 0 3 — 3 4 0 1 8 1 954. 特願 2 0 0 3 — 3 4 2 5 1 9

ページ: 1/E



認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-170051

受付番号 20308550874

書類名 出願人名義変更届(一般承継)

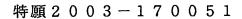
担当官 塩野 実 2151

作成日 平成16年 3月17日

<認定情報・付加情報>

【提出された物件の記事】

【提出物件名】 委任状(代理権を証明する書面) 1



出願人履歴情報

識別番号

[000006792]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名 埼玉県和光市広沢2番1号

理化学研究所

出願人履歴情報

識別番号

[503359821]

1. 変更年月日 [変更理由]

2003年10月 1日 新規登録

· 住 所 氏 名

埼玉県和光市広沢2番1号

独立行政法人理化学研究所

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.